

H 01 L

Ans.nr.: 0432/83

Indleveret: 03 feb 1983

Løbedag: 03 feb 1983

Alm. tilgængelig: 05 aug 1983

Prioritet: 04 feb 1982 US 345858

*PENNWALT CORPORATION; Philadelphia,
US.

Opfinder: Oliver Snyder *Sprout Jr.; US.

Fuldmægtig: Patentbureauet Hofman-Bang &
Boutard

Fremgangsmåde til fremstilling af rynkefri
piezoelektriske film ved poling

SAMMENDRAG

432-83

Piezoelektrisk aktivitet opnås i orienterede piezoelektrisk følsomme (PES) film ved at anbringe et enkelt filmslag eller flere filmslag indeholdende mindst én orienteret PES film mellem elastisk ledende gummilag og underkaste filmen/filmene et kraftigt jævnstrømsfelt.

Der opnås piezoelektrisk aktive film uden rynkning og uden fejl.

